

# DIN EN ISO 3868:1995-01 (D)

Metallische und andere anorganische Schichten - Messung von Schichtdicken -  
Fizeau-Vielstrahl-Interferenz-Verfahren (ISO 3868:1976); Deutsche Fassung EN ISO  
3868:1994

---

Inhalt	Seite
1 Anwendungsbereich .....	2
2 Prinzip.....	2
3 Definitionen.....	2
3.1 Okularfadenmikrometer.....	2
3.2 Einheiten des Fadenmikrometers.....	2
3.3 Fizeau-Platte .....	2
3.4 Streifen .....	2
3.5 Meßlinie .....	2
3.6 Versatz.....	2
3.7 Abstand .....	2
4 Prüfeinrichtung.....	2
5 Einflüsse auf den Meßwert .....	2
5.1 Reflektierende Schicht.....	2
5.2 Stufenform 2 .....	3
5.3 Ablesegenauigkeit.....	3
5.4 Ebenheit der Oberfläche .....	3
5.5 Stufenausbildung .....	4
5.6 Rauheit .....	4
5.7 Sauberkeit .....	4
5.8 Herstellung der Stufe .....	4
6 Kalibrierung .....	4
7 Durchführung.....	4
7.1 Herstellung der Stufe .....	4
7.1.1 Abdeckung vor dem Beschichten .....	4
7.1.1.1 Vor dem Beschichten ist ein Teil der Oberfläche .....	4
7.1.1.2 Der nicht abgedeckte Abschnitt der Oberfläche.....	4
7.1.2 Abdeckung nach dem Beschichten.....	4
7.1.2.1 Es ist die gesamte beschichtete Oberfläche .....	4
7.2 Durchführung der Messung .....	4
7.2.1 Die Objektfokussierung ist einzustellen und die .....	4
7.2.2 Der Winkel zwischen der Fizeau-Kontaktplatte.....	4
7.2.5 Die Verschiebung eines Streifens über die Stufe .....	4
8 Meßunsicherheit .....	5